

# 施設予約ポータル 操作マニュアル

## 目次

- 1. センター利用までの流れ …2p
- 2. アカウムの新規作成 …3p
- 3. 工程表の作成 …4p
- 4. 利用申請書の作成 …9p
- (参考) 装置一覧 …10p

施設予約ポータルURL:

<https://3dyoyaku.jp/base1/facility/portal/login/logout>

# 1. センター利用までの流れ

問い合わせ

- メール・電話等で問い合わせ

アカウント  
発行

- お客様用アカウントをお知らせ
- 初期設定 … 3p

機器の予約

- 担当研究員が工程表を作成
- 利用スケジュールの確定 … 4p

利用申請

- メールで利用申請書を提出 … 9p

実施

- センター利用



### 3. 工程表の作成

#### 工程表とは…

ご利用内容に応じた機器(プロセス)の選定と日程の調整を、案件毎に一括で行います。1件の利用申請書に1つの工程表が基本となります。

・新規の工程表は、担当研究員が作成します。

①作成した工程表は、トップ画面に一覧表示されます。

開始	顧客ID	顧客名	案件ID	案件名	状態	内容
2018-10-02	2	テスト企業	2-0010	試作	作成中	詳細   工程表   予定表
開始	顧客ID	顧客名	案件ID	案件名	状態	内容

②『工程表』ボタンを押すと入力済の情報が表示されます。

部屋   装置名	装置No	10月 08
CR-B(1)		
フィルムレジスト圧着装置	12	09:00 - 10:00
ソルダーレジスト乾燥炉	7	10:00 - 11:00
エッチング処理後乾燥炉(B)	23	11:00 - 12:00
めっきライン(1)		
デスマア装置	35	
基板用無電解めっき装置	36	
CR-B(2)		
フィルムレジスト圧着装置	12	
水平ライン(1)		
レジスト剥離装置	29	

- ・予約空き状況を確認する場合 ⇒ 5p
- ・利用日時を登録・変更する場合 ⇒ 6p
- ・利用機器を追加する場合 ⇒ 7,8p

※確定された工程表は、後から変更・追加が出来ません。  
変更・追加が必要な場合は、担当研究員へお知らせください。

### 3. 工程表の作成 ～予約空き状況の確認～

- ①『予定表参照』欄に日付を選択 ⇒ ②『移動』ボタンをクリック  
⇒ 別タブで予定表が開き、機器の予約空き状況を確認できます。

施設予約ポータル

戻る ① 予定表参照 2018/10/08 移動 ② 見積金額 96500 再読込み ダウンロード 保存

October 2018

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

部屋 | 装置名

- CR-B(1)
- フィルムレジスト圧着装置
- ソルダーレジスト乾燥炉
- エッチング処理後乾燥炉(B)
- めっきライン(1)
- デスマア装置
- 基板用無電解めっき装置

施設予約ポータル

戻る ④ 2018-06-12 機器/設備 部品内蔵基板 再読込み ログアウト ⑥

⑤

時間	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00
基板クランプ機構付走査型ロールコーター	09:00-12:00					13:00-16:00									
プリント基板真空プレス装置						13:00-15:00	15:00-17:00								
プリント基板用X線付イド次明機							15:00-17:00	17:00-19:00							
プリント基板穴明け機							13:45-17:00								
プリント基板外形加工機							13:00-16:00								
ソルダーレジスト乾燥炉						13:00-16:00									
ピン立て装置															
予熱ラミネーター															

青: 自社 緑: 他社 赤: 利用不可 グレー: 過去日

#### 【予定表の表示内容変更操作】

- ④日付、装置カテゴリ(部品内蔵基板／TSV／分析・検査等)を選択し、『再読込み』 ※カテゴリ別装置一覧は 10p
- ⑤機器名をクリック ⇒その機器の30日間の予約空き状況を表示
- ⑥前日、翌日の予定表を表示

### 3. 工程表の作成 ～利用日時の登録・変更～

#### 【日時の登録】

- ① 該当機器をダブルクリックで選択 ⇒ 入力用ポップアップ  
⇒ ② 利用日時を選択 ⇒ ③ 保存

The screenshot shows a Gantt chart interface for October 8th. The equipment list on the left includes 'フィルムレジスト圧着装置' (12), 'ソルダーレジスト乾燥炉' (7), 'エッチング処理後乾燥炉(B)' (23), 'めっきライン(1)' (35), and 'CR-B(2)' (12). A pop-up window is open for the 'フィルムレジスト圧着装置' on 08/10/2018, with the time set to 09:00. The '保存' (Save) button is highlighted with a red box.

#### 【日時の変更】

- ④ 変更したい機器のバーを左右にドラックして変更  
または、登録時と同じ手順で変更

The screenshot shows the same Gantt chart interface. The 'エッチング処理後乾燥炉(B)' bar is highlighted in yellow and has a red box around it with the number 4. The '保存' (Save) button in the top right corner is also highlighted with a red box and the number 5.

- ⑤ 『保存』ボタンを押すことで、変更内容が保存されると同時に、変更後の工程表を担当研究員も確認可能になります。

・工程表に入力している段階では、予定表には反映されません。  
担当研究員が『確定』することにより、予定表に反映されます。

・確定後、予約内容に誤りがないか、確認をお願いいたします。

### 3. 工程表の作成 ～利用機器を追加～

#### 【選択済の部屋の装置を追加する場合】

(例) 『水平ライン』の『レジスト剥離装置』を追加

- ① 部屋名の右横の+ボタンをクリック ⇒ ② 入力用ポップアップ  
⇒ ③ 装置と利用日時を選択 ⇒ 保存

The screenshot shows a software interface for creating an engineering table. At the top, there are navigation buttons: '戻る', '予定表参照', '開始日', '移動', '見積金額 22500', '再読み込み', 'ダウンロード', and '保存'. Below this is a table with columns for room names and device numbers, and a grid for time slots from 00:00 to 04:00. The room '水平ライン(1)' is selected, and its '+' button is circled in red with a '1'. The device 'レジスト剥離装置' (No. 27) is listed below it.

This screenshot shows the same interface as above, but with a pop-up dialog box open. The dialog box is titled '10 10月 2018 - 10 10月 2018'. It has a dropdown for '部屋名' (Room Name) set to '水平ライン(1)'. The '装置名' (Device Name) dropdown is circled in red with a '3' and set to 'レジスト剥離装置'. The '期間' (Period) is set to '2018/10/10 13:00 - 2018/10/10 14:00'. At the bottom of the dialog are buttons for '保存' (Save), 'キャンセル' (Cancel), and '削除' (Delete). A '2' is also circled in red next to the '+' button of the selected room.

#### 【選択済の装置を再度登録する場合】

一つの工程表で同じ装置を複数回(別日の使用も含む)利用する場合は、部屋の追加から操作が必要です。

※同じ装置を登録する場合は、部屋の枝番を活用する必要があります。

(例) 『レジスト剥離装置』を2回利用する

1回目: 部屋名『水平ライン(1)』 ⇒ 装置名『レジスト剥離装置』  
～ 別の装置を利用 ～

2回目: 部屋名『水平ライン(2)』 ⇒ 装置名『レジスト剥離装置』

※部屋名・装置一覧表 ……10p

### 3. 工程表の作成 ～利用機器を追加～

【未選択の部屋の装置を追加する場合】

(例) 『めっきライン』の『電解ビアフィルめっき装置』を追加

- ①装置No.の右横の+ボタンをクリック ⇒ ②入力用ポップアップ  
⇒ ③部屋を選択 ⇒ 保存

The screenshot shows a software interface for creating an engineering table. At the top, there are navigation buttons like '戻る' (Back), '予定表参照' (Reference), and '移動' (Move). A table lists rooms and their associated devices. The first room is 'CR-B(1)' with device '21' (プリント基板用直接描画装置). A red circle highlights the '+' button next to the device number. A second screenshot shows a pop-up window for adding a device to the selected room. The room name 'めっきライン(1)' is selected in a dropdown menu, and the '+' button next to the device number '21' is highlighted with a red circle.

- ④追加した部屋名の右横の+ボタンをクリック ⇒ ⑤入力用ポップアップ  
⇒ ⑥装置と利用日時を選択 ⇒ 保存

The screenshot shows the same software interface. The room 'めっきライン(1)' is now added to the table. A red circle highlights the '+' button next to the room name. A second screenshot shows a pop-up window for adding a device to the selected room. The room name 'めっきライン(1)' is selected in a dropdown menu. The device name '電解ビアフィルめっき装置' is selected in another dropdown menu. The date and time are set to '2018/10/10 14:00'. The '+' button next to the device number '21' is highlighted with a red circle.

## 4. 利用申請書の作成

- ・確定された工程表からダウンロードしたCSVデータは、利用申請書の作成に活用することができます。
- ・作成した申請書は、メールにて提出をお願いいたします。

【CSVデータ】『ダウンロード』ボタンから取り出すことができます。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	id_processe pid		id_products title		id	id_projects	date_start	date_end	quantity	price	amount
1	55	7	11	フィルムレジスト圧着装置	1793	2-0007	2018/10/2 9:00	2018/10/2 10:00	1	5400	5400
2	52	7	12	ソルダーレジスト乾燥炉	1794	2-0007	2018/10/2 10:00	2018/10/2 11:00	1	2400	2400
3	59	7	23	エッチング処理後乾燥炉(B)	1795	2-0007	2018/10/2 11:00	2018/10/2 12:00	1	2000	2000
4	21	3	35	デスマリア装置	1797	2-0007	2018/10/3 9:00	2018/10/3 12:00	3	12400	37200
5	22	3	36	基板用無電解めっき装置	1798	2-0007	2018/10/3 13:00	2018/10/3 15:00	2	10300	20600
6	355	151	14	フィルムレジスト圧着装置	1800	2-0007	2018/10/4 9:00	2018/10/4 12:00	3	5400	16200
7	16	2	29	レジスト剥離装置	1802	2-0007	2018/10/4 14:00	2018/10/4 15:00	1	12700	12700

【利用申請書データ(Excel)】2枚目の利用予定欄に貼り付け可能です。

No.	機 器 名	利用予定日	予定時間	実績時間	工 数	備 考	担当研 究 員
12	フィルムレジスト圧着装置	10/2	9:00 - 10:00				
(7)	ソルダーレジスト乾燥炉	10/2	10:00 - 11:00				
(23)	エッチング処理後乾燥炉(B)	10/2	11:00 - 12:00				
35	デスマリア装置	10/3	9:00 - 12:00				
36	基板用無電解めっき装置	10/3	13:00 - 15:00				
12	フィルムレジスト圧着装置	10/4	9:00 - 12:00				
29	レジスト剥離装置	10/4	14:00 - 15:00				

【CSVデータ】⇒【利用申請書データ】

D列 ⇒ D列 (黄色)

GH列 ⇒ IJ列 (青色)

※必ず、「値の貼付け」を行ってください。

※1枚目には必要事項をご入力ください。

利用申請書の提出先

担当研究員 及び [3d-riyo@ist.or.jp](mailto:3d-riyo@ist.or.jp)

利用申請書(新)様式ダウンロード先

<http://itoshima-3dsemi.com/information.html>

(三次元センターテクニカルWeb)

# (参考) 装置一覧

## 【装置一覧表】

水平ライン	
装置No.	装置名
13	基板処理前乾燥炉
27	基板用現像装置
28	ソフトエッチ水洗装置
29	レジスト剥離装置
31	基板用ケミカルエッチング装置
s7	基板用Ni/Auめっき

めっきライン	
装置No.	装置名
25	基板用バフ研磨装置
34	積層前粗化処理装置
35	デスマリア装置
36	基板用無電解めっき装置
37	電解ピアフィルめっき装置

プレス・機械加工室	
装置No.	装置名
2	プリント基板真空プレス装置
3	プリント基板用X線ガイド穴明機
4	プリント基板穴明機
5	プリント基板外形加工機
8	ピン立て装置
20	プリント配線板用UV+CO2レーザ加工機

実装エリア	
装置No.	装置名
14	アンダーフィル塗布機
15	メタルマスク洗浄装置
16	プリント基板用高速スクリーン印刷機
17	プロダクションモジュラー
18	導通試験テストデータ加工データ作成装置
19	大型基板対応フリップチップボンダ
24	鉛フリー対応N2リフロー装置
26	真空密閉超音波洗浄装置
32	内蔵部品検査装置
18-2	露光データ&ドリルデータ作成用PC

信頼性試験室・検査室・電気特性評価室	
装置No.	装置名
57	プロービングシステム
58	高周波パラメータ測定システム
59	TDRオシロスコープ
60	恒温恒湿振動試験機
61	衝撃試験装置
62	自動切断機
63	自動研磨機(64 研磨濾過器含む)
74	基板パラメータ測定システム
L1	レーザー顕微鏡
L9	ビール試験機
L10	マイグレーション評価装置

CR-B	
装置No.	装置名
1	基板クランプ機構付き真空式ロールコーター
7	ソルダーレジスト乾燥炉
9	予熱ラミネーター
11	クリーンローラー
12	フィルムレジスト圧着装置
21	プリント基板用直接描画装置
30	プリント基板用プラズマクリーナー
33	AOI(光学式外観検査装置)
23	エッチング処理後乾燥炉(B)

CR-C	
装置No.	装置名
56	半導体試験装置
66	マイクロフォーカスX線透視装置
L4	ボンドテスタ
L5	FIB
L2	フリップチップボンダー
L3	ワイヤーボンダー

CR-D	
装置No.	装置名
43	ガラス(支持)基板貼合せ装置
44	ガラス(支持)基板剥離装置
45	照射器移動方式紫外線照射装置
46	オートマチックサーフェスグラインダー
48	オートマチックダイシングソー
49	ストレスリリーフ装置
23	エッチング処理後乾燥炉(D)

CR-E	
装置No.	装置名
47	8インチ用ウエハマニュアル洗浄装置
53	ウエハカップ式銅メッキ装置
55	半導体用クリーンルーム対応リフロー炉
s1	ウエハ銅ポストめっき
s2	SnAgめっき
s3	Niめっき
s4	Ni/Auめっき
s6	二流体洗浄装置
23	エッチング処理後乾燥炉(E)
s8	PR/パルスCu

CR-F	
装置No.	装置名
50	リアクティブイオンエッチャー
51	絶縁膜形成装置
52	縦型酸化炉
54	超小型蒸着装置
65	電界放出型分析走査電子顕微鏡システム
67	光学顕微鏡
68	実体顕微鏡
s5	チタン/Cu スパッタ
L8	酸化膜エッチング装置(10NR)

CR-G	
装置No.	装置名
40	微細パターン加工装置
41	スピコーター
42	アルカリデベロッパ
L7	ウエハプラズマクリーナー

**【装置カテゴリ】**

部品内蔵基板 : 緑  
 TSV : 青  
 分析・検査等 : 黄